

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成20年12月18日 (2008.12.18)

【公表番号】特表2002-514751(P2002-514751A)

【公表日】平成14年5月21日 (2002.5.21)

【出願番号】特願2000-548703(P2000-548703)

【国際特許分類】

G 0 1 N 27/416 (2006.01)

G 0 1 N 1/00 (2006.01)

G 0 1 N 1/22 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 N 27/46 3 1 1 G

G 0 1 N 1/00 1 0 1 R

G 0 1 N 1/22 K

【誤訳訂正書】

【提出日】平成20年10月27日 (2008.10.27)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【 0 0 1 7 】

第 1 図を参照すると、示されている分析器 1 は、気体サンプルを乾燥する乾燥作動モジュールを形成する浸透膜乾燥機 2 を備え、前記乾燥機は、入口 3 と出口 4 とを有している。乾燥機の入口 3 は、気体サンプルを採取して、注入するノズル 5 に接続されている。さらに、乾燥機の入口から最も遠い前記ノズルの端部には、一次フィルタ 6、すなわち、例えば、20 μm よりも大きなサイズの固体粒子を保持し、かつ分析のためにサンプルされる気体が流動するライン 7 を通る、特にセラミック製の焼結式物質から成るフィルタが設けられている。乾燥機 2 の入口に接続されているその端部で、ノズル 5 には、例えば、0.3 μm よりも大きなサイズを有する固体粒子を保持する細かいフィルタ（図示せず）が設けられている。